

FACSIMILE DEVICE**BEST AVAILABLE COPY**

Patent Number: JP59153376
Publication date: 1984-09-01
Inventor(s): SAKAKIBARA KENZOU
Applicant(s):: CANON KK
Requested Patent: JP59153376
Application Number: JP19830026977 19830222
Priority Number(s):
IPC Classification: H04N1/22
EC Classification:
Equivalents:

Abstract

PURPOSE:To attain recording with proper density with simple constitution by driving a heater by a dummy data at a low voltage at non-recording during the receiving of the group II in a device in common use for the groups II and III of the CCITT recommendations.

CONSTITUTION:In the facsimile device in common use for the groups GII and GIII modes in accordance with the CCITT recommendations T3, a received data is demodulated by a modulation and demodulation device 102, decoded by a controller 103 and stored once in a storage section 106, and transmitted to a thermal head 109 and recorded. The recording operation of the head 109 is controlled by the controller 103 via a timing signal generating circuit 107 and a voltage switching circuit 108. The circuit 108 drives the heating elements of the head 109 at the non-recording during the receiving of the GII mode while switching the voltage to a low voltage to the degree that the thermal sensing paper is not developed color by a dummy data so as to keep the temperature of the heating elements. Thus, the data is recorded at a proper density both for the GII and GIII modes.

Data supplied from the esp@cenet database - I2

⑬ 日本国特許庁 (JP)

① 実用新案出願公開

⑫ 公開実用新案公報 (U)

昭59—153376

⑤ Int. Cl.³
C 25 B 9/00
1/46

識別記号

庁内整理番号
D 6686—4K
6686—4K

③ 公開 昭和59年(1984)10月15日

審査請求 未請求

(全 3 頁)

⑭ フィルタープレス型イオン交換膜法電解槽

⑫ 考 案 者 三橋弘幸

岡山市下中野39番地

② 実 願 昭58—46712

⑩ 出 願 人 クロリンエンジニアズ株式会社

② 出 願 昭58(1983)4月1日

東京都港区虎ノ門二丁目1番1

⑫ 考 案 者 四宮吉継

号商船三井ビル

玉野市田井2丁目17—16

⑭ 代 理 人 弁理士 森浩之

⑮ 実用新案登録請求の範囲

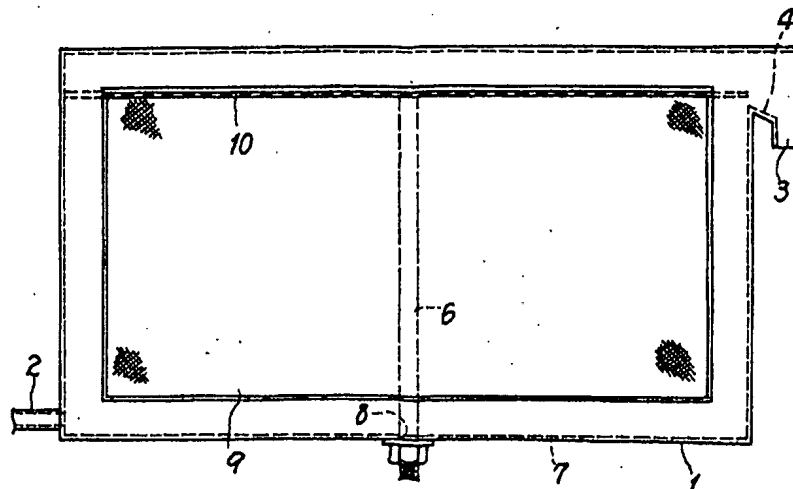
- (1) 額縁状の電極フレームの両面に電極板を溶接してなる電極構造体がイオン交換膜により区画されたフィルタープレス型イオン交換膜法電解槽において、電極板の上端又は上端より上方の電極フレームの上部に、少なくとも一部がメッシュ構造の泡沫成長抑止体を設置したフィルタープレス型イオン交換膜法電解槽。
- (2) 泡沫成長抑止体の全部がメッシュ構造とされた実用新案登録請求の範囲第(1)項に記載のフィルタープレス型イオン交換膜法電解槽。
- (3) 泡沫成長抑止体が、多数の円形メッシュが嵌込まれた板体である実用新案登録請求の範囲第(1)項に記載のフィルタープレス型イオン交換膜法電解槽。

図面の簡単な説明

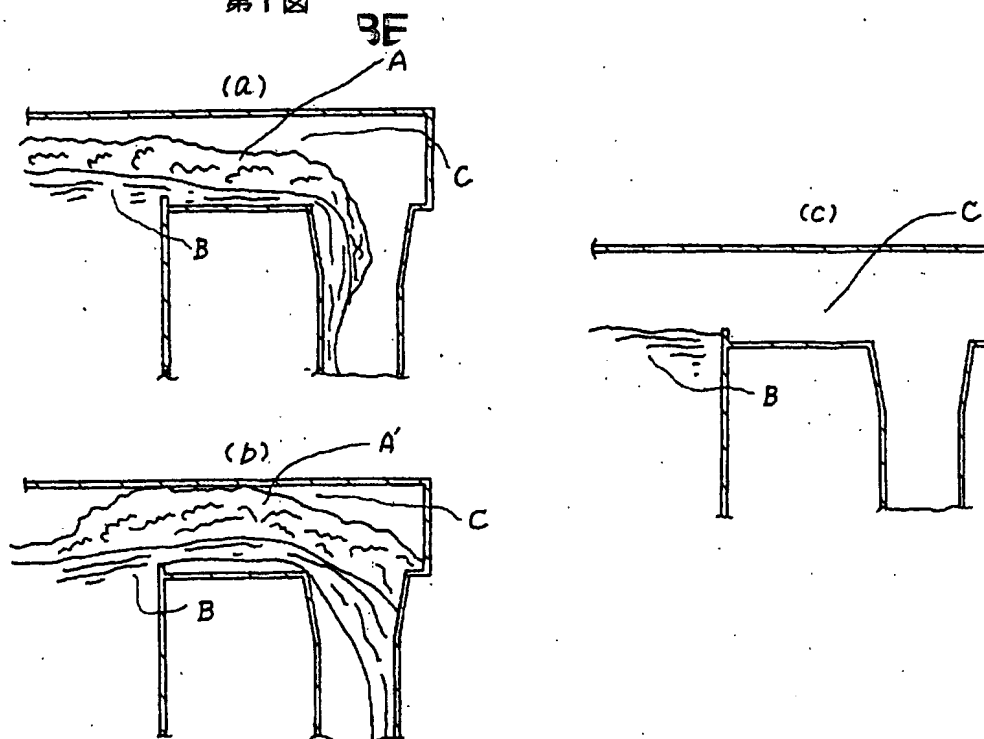
第1図a, b, cは、従来のフィルタープレス型電解槽の電解液の出口付近に蓄積する泡沫に基因する電解槽内の圧力変動を説明するための概略図、第2図は、本考案のフィルタープレス型イオン交換膜法電解槽の電極フレームを示す正面図、第3図は、本考案のフィルタープレス型イオン交換膜法電解槽の一実施例を示す一部破断斜視図、第4図は、同じく要部の縦断面図、第5図a, b, cは、本考案の泡沫成長抑止体の例を示す斜視図である。

1……電極フレーム、2……電解液供給管、3……電解液取出管、9……電極体、10……泡沫成長抑止体、11……気泡、12……泡沫。

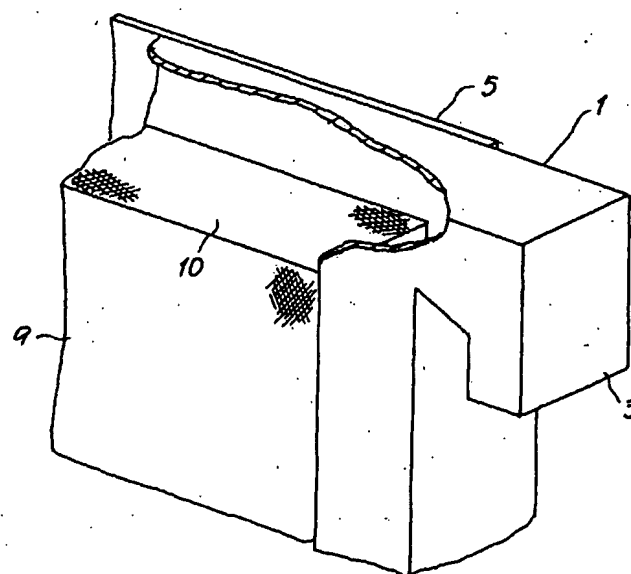
第2図



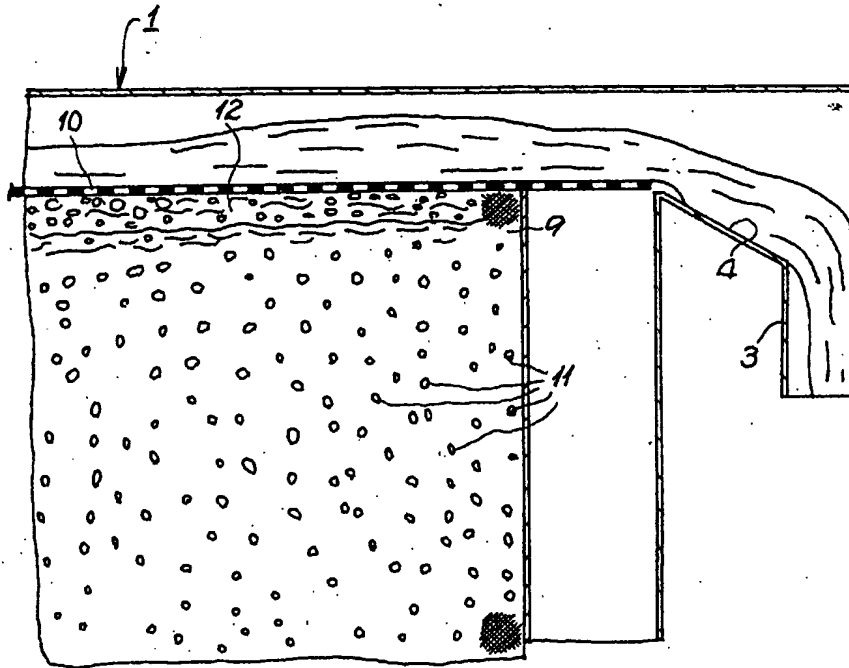
第1図



第3図



第4図



第5図

